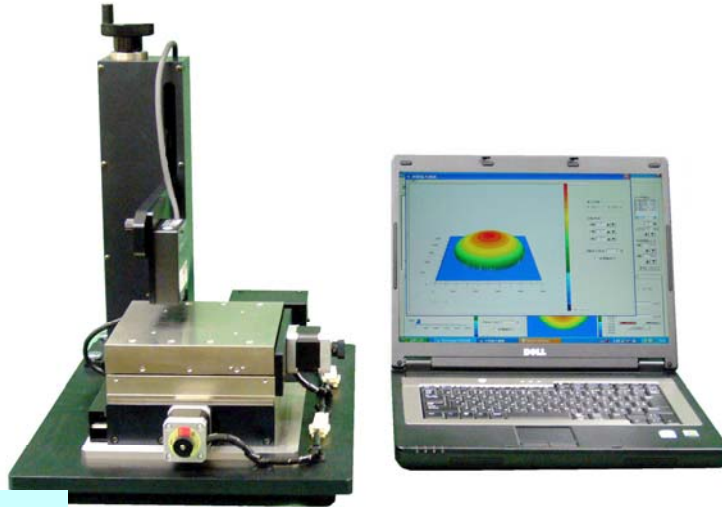


TDS2100  
シリーズ

# 非接触三次元形状測定装置



## 低価格

小型で場所をとりません  
高速測定  
操作が簡単

### 特長

- ・ 小型、低価格にて高精度な測定を実現
- ・ 市販のレーザー変位センサが使用できます
- ・ データ収集が高速
- ・ 非接触なので検査対象を傷つける心配がありません
- ・ 透明体、あるいは鏡面体の測定が可能
- ・ 測定対象物による影響が非常に少ない
- ・ 各種解析ツール使用によりらくらく解析作業
- ・ 多彩な計測モードを用意
- ・ ご使用の対象物形状に合わせてシステム構築が可能
- ・ 特注歓迎します

### 用途

- ・ 液晶基板や半導体ウェハなどのそりや表面形状測定
- ・ 液晶シール材の断面積測定
- ・ 基板上のクリーム半田の形状測定
- ・ 光ファイバー接続断面の形状測定
- ・ ピックアップレンズの球面形状測定
- ・ 繊維等の表面積測定
- ・ ブレードの先端形状測定
- ・ その他樹脂、金属加工品の平面度や表面形状の測定

・仕様

SS21自動ステージシステム一覧表

■XY自動ステージ部

型 式	SS21-80XY	SS21-200XY	SS21-300XY
移動量	80mm	200mm	300mm
テーブル面	172×172	220×220	320×320
センサ部Y軸ステージ(手動)	70mm		
センサ部Z軸ステージ(手動)	100mm		
最小送り量	0.1 μm/STEP(設定可変)	0.1 μm/STEP(設定可変)	0.1 μm/STEP(設定可変)
最高移動速度	30mm/SEC(機械的最大)	40mm/SEC(機械的最大)	40mm/SEC(機械的最大)
耐荷重	20Kg	20Kg	20Kg
位置決め精度	8 μm以内 (最大移動時)	20 μm以内 (最大移動時)	25 μm以内 (最大移動時)
繰り返し位置決め精度	±1 μm以内	±2 μm以内	±2 μm以内
真直度	10 μm以内 (最大移動時)	20 μm以内 (最大移動時)	30 μm以内 (最大移動時)
バックラッシュ・ロストモーション	3 μm以内	3 μm以内	5 μm以内
外形寸法	W340×H460×D450以下	W400×H300×D550以下	W500×H300×D650以下
重量	25Kg以下	36Kg以下	45Kg以下

■制御部

軸数	2軸		
ステージドライバ	5相マイクロステップドライバ		
USB I/F	USB1.1/2.0		
アナログ部	電圧入力(±3V,±5V,±8V,±10V,other) 16Bit A/D変換		
外形・重量	W353×H110×D205 4Kg以下		
消費電力(動作時最大)	AC100V±10% 50/60Hz 60W以下	AC100V±10% 50/60Hz 120W以下	AC100V±10% 50/60Hz 200W以下
ソフトウェア WinLaser3D	OS Windows2000,XP,Windows7対応		

■オプション

オプションで下記のものを用意しております。その他にもご希望により対応させていただきますので、ご相談下さい。

カラープリンタ、卓上型防振台、防振台付き測定デスク、パソコンラック、各種ワーク固定治具、各種手動ステージ(Y,θ,傾斜)、基準ブロックゲージなど

仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

この仕様以外にも対応可能ですのでご相談ください。